

開示の要約

サブファブエリア設置装置

- 5 半導体を製造する際に使用される消費電力を下げることができるサブファブエリア設置装置が開示される。サブファブエリア設置装置は、半導体製造装置の処理チャンバから処理ガスを排気するための真空ポンプと、処理チャンバで使用された第1循環液を冷却するための冷却ユニットと、処理チャンバで使用された第2循環液を加熱するための加熱ユニットと、真空ポンプから排出された処理ガスを除害するための除害装置と、冷却源から供給される冷却液が流れる冷却液ラインとを備える。冷却液ラインは、除害装置、真空ポンプ、および冷却ユニットを通過した冷却液を加熱ユニットに供給する第1下流側ライン、第2下流側ライン、および第3下流側ラインを有している。
- 10

15 図2